

国家高技术研究发展计划（863 计划）先进制造技术领域
“典型 MEMS 器件设计制造与应用关键技术”主题项目
申请指南

863

863

一、指南说明

863

“ MEMS

”

2006-2020

863

MEMS

MEMS

MEMS

MEMS

MEMS

MEMS

MEMS

8800

8

二、指南内容

1

MEMS

MEMS

MEMS

1

60~150MPa

-40~+200

0.2%FS

MTBF≥3

1

2

500

1

3

≥80%

≥300

/

2011

1

2013

12

1000

550

2

MEMS

MEMS

1	0.05%FS	0.075%FS	
	6KPa~50MPa	≤0.05%/	
-40~+85	MTBF≥2		
2	0.05%FS		
	0.075%FS		≥80%
≥95%	10		
3			
	≤25%	≥80%	≥300 /
	2011 1	2013 12	
			1000
550			
3	ESP		
	MEMS		
	ESP		
	ESP		
	ESP		
1	±250°/s	≤0.5°/s	≤0.5%
1			

2		$\pm 5g$	$\leq 50mg$	$\leq 1\%$
1				
3				ESP

4				
	$\geq 80\%$	≥ 100	/	
	2011	1	2013	12
				1200
	550			

4 CMOS-MEMS

CMOS-MEMS

CMOS-MEMS

CMOS-MEMS

5

MEMS

MEMS

MEMS

1 MEMS

-180dB

≥3MPa

≥ 50m

-2.5~+30℃

≥80%

500

2 MEMS

-40~+60

0~6mm

1mm

MTBF ≥10000h

5000

2011

1

2013

12

1000

550

6

MEMS

MEMS

1	200V/m	7.5%	500V/m~50kV/m	100		
2	200V/m	10%	500V/m~50kV/m	100		
		2011	1	2013	12	1200
	550					
	7					
1	85%	50	4~16 mmol/L	≥		
2	≥ 90%	50	2.8~22.2 mmol/L			
3	500		±5%	≤0.05		

≤ 0.05

8

 2×10^{-10}

5

1000

150

5

4

3 2010 12 8 17

4 “

” program.most.gov.cn

863

863

5

010-68338038 010-68338942

E-mail ohj@htrdc.com shengyl@htrdc.com

863

0 0